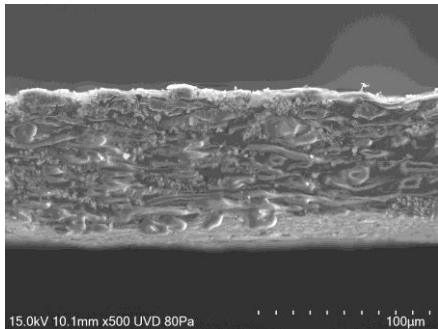


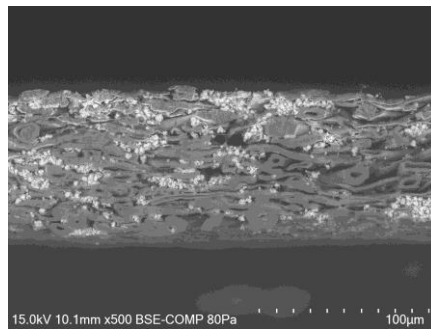
普通紙の断面観察

低真空モード観察

イオンミリング法

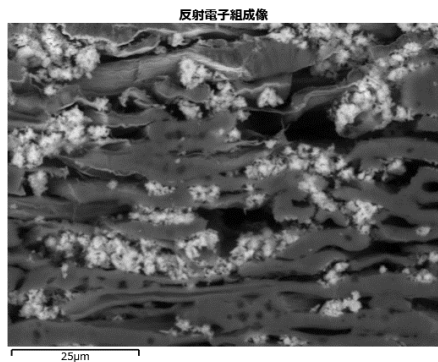


二次電子像

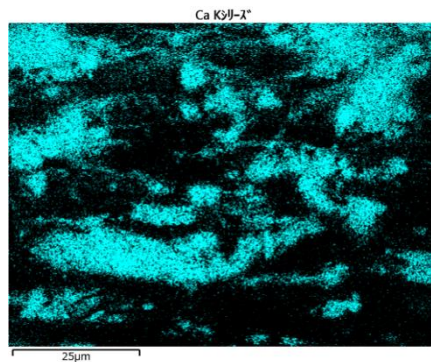


反射電子組成像

× 500



反射電子組成像



Ca

× 1,500

【作業工程】

試料の切り出し

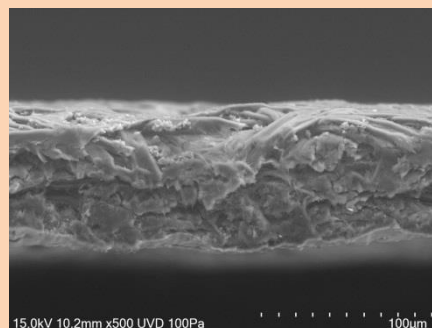


イオンミリング法による断面加工



FE-SEM による低真空観察

ハサミによるカット



二次電子像

やわらかい材料の断面観察・構造観察ができます